第 4 回 EUV 研究会の御案内

EUV フォトン（株）では、下記要領にて第 4 回 EUV 研究会を開催致します。業務御多忙と存じますが、是非参加を御検討下さい。

記

◆ 日　時：　２０２５年６月４日（水）　　研究会　１４：００～１７：２５
　　（終了後に交流会を開催します）

◆ 場　所：　JR 博多シティー１０階　A＋B 会議室

◆ 参加費：・一般の方々：お一人 55,000 円(消費税込み)を申し受けます(銀行振り込み(下記)にて)
　　・パートナー企業様：２名までは無償です。3 名以上分については上記と同額です

◆ 内　容：

１４：００～１４：０５　開会

１４：０５～１５：０５　「More Moore、そして Moore 2.0 へ」
　　大阪公立大学
　　笹子 勝

１５：０５～１６：０５　「EUV リソグラフィーの発展シナリオと材料・部材開発への期待」
　　ASML ジャパン
　　永原 誠司

１６：２０～１７：２０　「EUV レジストの評価」
　　リソテックジャパン
　　関口　淳

１７：２０～１７：２５　閉会

１７：２５～１７：４５　名刺交換会

◆ 交流会：１７：５０～開催します。会場は別途ご案内申し上げます。
　　参加費 5,500 円(当日に現金にてお支払いいただきます(領収書を発行します))

◆ 参加申込：下記内容を contact@euvphoton.jp 宛て E メールにてお送りください。

件名：第 4 回研究会参加希望
区分：　パートナー企業　または　一般
ご所属機関名：
参加の皆様全員のご氏名・メールアドレス：
交流会出席者のご氏名：

◆ 研究会参加費お振込み先：
　　銀行名：福岡銀行 周船寺支店
　　口座種別・番号：普通口座　857249
　　口座名義：EUV フォトン株式会社
　　イーユーブイフォトン(カ

◆次回予告：２０２５年８月で計画中です。プログラム決定次第ご案内します。

以上